Support Request Form　利用相談フォーム

Please fill in this form and send it to Electron Microscopy Unit office as an email attachment.

依頼内容をご記入いただき、電子顕微鏡ユニット事務局までメール添付にてお送りください。

*Email: tem@nims.go.jp*

The technical staff member in charge will provide a usage consultation based on the following information.

以下の内容をもとに、担当の技術スタッフが利用相談を行います。

〈Date日付: *month*月 *day*日 *year*年〉

|  |
| --- |
| **User information** 利用者情報 |
| **Applicant**申請者 | **Name**氏名（フリガナ） |  |
| **Company (Organization)/Division**会社（組織）名・所属 |  |
| **Job Title/Position**職名/肩書　 |  |
| **Grade** For students **Period of stay in NIMS** for members of NIMS internship program |  |
| **Period of stay in NIMS** for visiting researchers  |  |
| **E-mail address** |  | **Phone Number**  |  |
| **Supervisor**責任者 | **Name**氏名（フリガナ） |  |
| **Company (Organization)/Division**会社（組織）名・所属 |  |
| **Job Title/Position**職名/肩書 |  |
| **E-mail address** |  | **Phone Number**  |  |

|  |
| --- |
| **For people from companies and academia　企業・大学等の方へ** |
| Please select one option regarding the research outcomes obtained through shared use.共用設備利用で得た研究成果公開の有無について、どちらかを選択して下さい。 | [ ]  Disclosure of Research Results 成果公開[ ]  Non-Disclosure of Research Results 成果非公開 |
| Please answer the following options about data provision if you are considering using “**ARIM”**. **「マテリアル先端リサーチインフラ」**をご検討の方は、データ提供ご協力の有無についてお聞かせ下さい。 | [ ]  I am interested in data provision for ARIM.ARIMへのデータ提供について検討している[ ]  I use ARIM without data provision.データ提供無しでARIMを利用する[ ]  I am not sure. よくわからない |

|  |
| --- |
| **Research Summary** 研究概要 |
|  |

|  |
| --- |
| **For NIMS users only 　NIMS内部利用者の方へ** |
| Please fill in an application ID if obtained. 既に課題IDを取得済みの方はご記入ください。Ex) 24NMXXXX |  ID: NM | About Data Provision データ提供について | [ ]  Cannot provide data due to confidentiality obligations. 守秘義務によりデータ提供できない |

|  |
| --- |
| **Selection of the usage type and related questions** 利用形態の選択と質問 |
| **Please select A or B for your preferred usage type.　利用形態のご希望について、AもしくはBをお選びください****For the selected usage type (A or B), please check the ones that apply to you.** **選択した利用タイプについて、ご回答ください****--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**[ ]  **A. Equipment Operation by users　機器利用**⇒　Operate equipment and acquire data by yourself ユーザー自身が機器を操作しデータを取得▶Please select the type of equipment you wish to use and *provide the name of the equipment* if you have specified ones. (e.g., JEM-2100) ご希望の装置種を選択いただき、指定機器があれば*装置名をご記入ください*（JEM-2100等）[ ]  TEM ：[ ]  SEM ：　　　　　　　[ ]  FIB ： 　　　　[ ]  Others その他：　　　 ▶ Which of the following would you judge your experience to be? あなたの経験は次のどれに当てはまると思いますか？ [ ]  Having no experience at all 全く経験がない[ ]  Having enough practical skill 十分経験がある　 ▶ Please indicate for reference the model(s) you have experience in NIMS by checking boxes or write the name.参考のため、NIMS施設で使用経験のある装置にチェックを入れて下さい。リスト以外の場合はご記入ください。

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipment model name** | **Equipment location** |
| [ ]  JEM-ARM300F, [ ]  JEM-2800, [ ]  JSM-7900F, [ ]  SMF-1000, [ ]  Scios2, [ ] Auriga Laser | SENGEN site(Advanced Structural Materials) |
| [ ]  JEM-2100F, [ ]  JEM-2100, [ ]  JEM-ARM200F, [ ]  Helios 650, [ ]  NB5000, [ ]  JIB-4000  | SENGEN site (Physical Analysis Laboratories) |
| [ ]  Talos F200X, [ ]  Ethos NX5000, [ ]  NanoMill Model1040 | NAMIKI site |
| Equipment other than the above　上記以外の装置： |

[ ]  **B. Equipment Operation on behalf of users　技術代行**　　 　　　⇒　Operate equipment and acquire data by EM unit 電子顕微鏡ユニットによる分析支援サービス　 ▶Please check appropriate boxes as follows. 当てはまるものにチェックを入れて下さい。　　　 [ ]  TEM Sample preparation and TEM observation TEM試料作製とTEM観察　[ ]  Only TEM sample preparation TEM試料作製のみ　　[ ]  Only TEM observation TEM観察のみ[ ]  SEM observation SEM観察　　※Please provide details of your preferred measurement method and sample information on page 4.　ご希望の測定手法および試料情報の詳細は、4・5ページ目に記載ください。 |
| **Sample Information** 試料情報 |
| **Sample Name**試料名 |  |
| **Sample Type, Form, Structure** 試料の構成  | [ ]  Bulkバルク　[ ]  Monolayer単層膜　[ ]  Multilayer多層膜[ ]  Nano-sized particles ナノサイズ粒子[ ]  Micron-sized particles ミクロンサイズ粒子[ ]  Others: その他： |
| **Electrical Characteristics**電気特性 | [ ]  Conductor導体、[ ]  Semi-conductor半導体、[ ]  Insulator絶縁体 |
| **Magnetic Property**磁気特性 | [ ]  Ferromagnetic (Fe/Co/Ni）強磁性（鉄/コバルト/ニッケルなど）[ ]  Ferrimagnetic (Ferrite etc.) フェリ磁性（フェライトセラミックスなど）[ ]  Non-Magnetic非磁性 |
| **Elements contained in the sample**含有元素 |  |
|  |
| **If the material contains biological components, please answer the questions on the right."** 生物由来の材料を含む場合は、右の設問に回答ください。 | **Does it contain pathogens?**病原を含みますか？ | [ ]  Yes [ ]  No |
| **Can it be handled in a regular laboratory without a BSL rating and not equipped for GMO experiments?**BSLの格付けがなく、遺伝子組み換え実験に対応していない通常の実験室で取り扱えますか？ | [ ]  Yes [ ]  No |
| **Precautions when handling sample** 試料に関する注意事項 |
| [ ]  Toxic劇物・毒物　　[ ]  Diffusible拡散性　[ ]  Volatile揮発性 [ ]  Oxidizable酸化性 [ ]  Photoreactive光反応性　[ ]  Heat-resistant temperature 耐熱温度［　　　　　　　℃］ 　[ ]  Water reactive水反応性[ ]  Intolerance for organic solvent such as ethanol or acetone耐薬品性（アセトン・エタノール） 　[ ]  Destruction Allowed破壊可　　[ ]  Destruction not Allowed破壊不可　[ ]  Others to be notedその他［　　　 　　　　 　　　　 ］　　 |
| **Remarks (if any)**その他特記事項 |  |

* **Pease fill in the following only if you wish to have a "Technical Surrogate".**

**以下は技術代行をご希望の方のみご記入ください。**

* If you do not have enough space, please add pages. Other attachment accepted.

スペースが足りない場合は、ページを追加してください。別紙添付でも可

|  |  |
| --- | --- |
| **Number of Samples** 試料数　 |  |
| **Please set priorities for which sample to start with If there is more than one sample.**試料が複数ある場合、優先順位を教えて下さい |  |
| **Directions of observation** 観察方向 | [ ]  Cross section断面　 [ ]  Plan view平面　 [ ]  Any direction 方位不問 |
| **Sample disposal** 試料廃棄について | [ ]  It is OK to dispose of them. 廃棄してよい[ ]  I need the samples returned. 試料の返却を希望する |
| **Detailed information about your sample**詳細な試料情報　*※ Not necessarily required if sample preparation is not requested.試料作製を依頼しない場合は必須ではない* |
| *Initial form, size, surface roughness, crystal orientation to observe, region of interest as specifically as possible to easy understand using schematic drawings or photos.　In case of Crash and Dispersion method, write the name of usable and unusable solvent.**初期形状・サイズ、表面の状態、観察したい結晶方位、特定の加工希望位置の全体写真とその部分の拡大写真、平面図、断面図などわかるように記載ください。分散法など懸濁が必要な場合は、使える溶媒と使えない溶媒を記載ください*。 |
| **Detailed information about analytical techniques you request**依頼したい分析手法　*※ You don’t need this information if you request only sample preparation. 試料加工のみ依頼の場合は不要* |
| *TEM: HR-TEM, STEM-EDS, STEM-EELS, EDS Mapping, Line Analysis, Electron Diffraction Pattern etc.**HR-TEM、STEM-EDS、STEM-EELS、マッピング、線分析、電子線回折図形等。**SEM: surface observation, cross-sectional observation, EDS measurement, EBSD measurement etc.* *表面観察，断面観察，EDS測定，EBSD測定等* |